Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2001-071511

(43)Date of publication of application: 21.03.2001

(51)lnt.Cl.

B41J 2/16

(21)Application number: 11-251184 (22)Date of filing: 06.09.1999 (71)Applicant: RICOH CO LTD

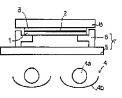
ng: 06.09.1999 (72)Inventor: YAMANAKA KUNIHIRO

(54) METHOD FOR FORMING LIQUID CHAMBER IN INK JET PRINTER HEAD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To execute heat-bonding of substrates in a short time in the case where a substrate laminated body for forming a liquid chamber of an ink jet printer head is produced.

SOLUTION: A layer of an adhesive that represents and adhesive force by heating is interposed between substrates and the adhesive layer is heated by a lamp light source and then the substrates are bonded to form a substrate laminated body. When the silicon substrate 1, 3 are bonded with each other, a thermoplastic polyimide series adhesive 2 (organic solvent) is coated on the surface of the substrate 1 to be bonded and leveling, preliminary drying and making of film is applied to the adhesive 2. The substrate 1 is loaded on a support member 7 of quartz and the substrate 3 is aligned to be loaded in contact with the substrate 1. While these substrates 1, 3 are pressed by a pressing plate 8, the adhesive 2 (together with the substrates) is concentratively heated by a halogen lamp 4a, thereby achieving the bonding of the substrates 1,3.



(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-71511 (P2001-71511A)

(43)公開日 平成13年3月21日(2001, 3, 21)

(51) Int.Cl.7			
B411	2/16		

識別記号

FI B41J 3/04 デーマコート*(参考) 103H 2C057

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 5 頁)

(21)出願番号	特顯平11-251184	(71)出題人 000006747
		株式会社リコー
(22)出顧日	平成11年9月6日(1999.9.6)	東京都大田区中馬込1丁目3番6号
(a) land	1,44-1, 1,7-1, 1,1-1,1-1,1	(72)発明者 山中 邦裕
		東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
		会社リコー内
		F 夕一ム(参考) 20057 AF34 AF70 AF93 AP02 AP25
		AP27 AQ02

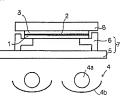
(54) 【発明の名称】 インクジェットプリンタヘッドの液室作製方法

(57) 【要約】

【課題】 インクジェットプリンタヘッドの液室構成用 の基板積層体を作製するに際し、基板同士の加熱接合を 短時間に行う。

【解決手段】 加熱により接着力を発現する接着剤の層を基板即に介在させ、読録業剤層をランプ光質の加熱することにより基板側でを接合して基板積層体を得る。実施側ではシリコン基板1と05をの接合に際し、基板1の接合面に熱可塑性ポリイミド系の接着料20/年期機成。它盤布し、接着剤2のレベリング・予備数線・フルル化を行った。基板1を不安からなる支持維材/上に載せ、この基板1上に基板3をアラインメントして軟置

・接触させ、これらの基板を加圧板8で加圧しながら、 ハロゲンランプ4aにより(基板および)接着剤2を集 中的に加熱することで基板同士の接合を完了させた。



- 1 ……基板 2 …熱可塑性ポリイミド系接着剤
- 3 …基板 4 …ランプ光源
- 4 a…ハロゲンランプ 4 b…反射板
 - 5 …支持板 6 …支持具
 - 7…支持部材
- 8…加圧板

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被数の基板を接合機層してなる基底機構 体によりインタジェットアリンタペットの被塞を作戦す るに際し、接合するべる基底側に、海索により装着力を 発現する接着剤の層を介在させ、該接着剤層をランプ光 源で加熱することにより前部基板両士を接合して前配基 板頭層体を得ることを特徴とするインクジェットプリン タペッドの機能に製力法。

【請求項2】 前記複数の基板がシリコンからなること を特徴とする請求項1に記載のインクジェットプリンタ ヘッドの演案作製方法。

【請求項3】 前記ランプ光源として短波長アークランプを用いることを特徴とする請求項2に記載のインクジェットプリンタヘッドの被室作製方法。

【請求項4】 前記接着剤として熱可塑性ポリイミド系 接着剤を用いることを特徴とする請求項1,2または3 に記載のインクジェットプリンタヘッドの被盗作製方 注

【請求項5】 前距熱可塑性ポリイミド系接着剤として、ガラス転移温度が120℃以上のものを用いることを特徴とする請求項4に記載のインクジェットプリンタヘッドの溶室作動方法。

【請求項6】 前記基板同士の接合工程がランプ光源を 用いる短時間の仮接合工程と、その後のランプ光源を 用いる接食工程とを含むものであり、該本接合TEを刊 前配仮接合工程よりも長時間または高温の加熱を行うこ とを特徴とする請求項4または5に記載のインクジェッ トプリンタの、10の第金作列方法

【請求項7】 前記接着剤として熱硬化性ポリイミド系 接着剤を用いることを特徴とする請求項1,2または3 に記載のインクジェットプリンタヘッドの被室作製方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェットプ リンタ〜ッドの被室を構成するための、複数の基板を接 合積層してなる基板積層体の作製方法に関し、更に詳し くは、上記基板両側士の接着方法に関するものである。 【0002】

【従来の技術】従来、インクジェットプリンケヘッドの 被窓構成用の基板積層体を得る場合において、基板同士 を接着によりほう合わせる力法としては、接着フィルム がラミネートされているか、または接着剤が能布されて いる基板を、接接合基板に振ね合わせて親圧着する方法 が一般的に展刊されている。

【0003】近年、インクジェットプリンタの高解像度 化に伴い、インクジェットプリンタへッドを構成する部 材では構造の微細化が進んでおり、このため熱圧着に蔚 しては、高精度のアラインメントが要求される。この熱 圧着方法には、基板を加圧時具にアラインメントして設 置した後、この加圧治具を加熱炉へ投入する方法や、ヒ ーター内蔵のプレス機を用い、ヒーター内蔵のステージ にて接合基板を加圧(プレス)する方法がある。

[0004]

【発明が解決しようとする問題】しかし、前等の熱圧着 方法においては、加圧指長が所望の温度に到達するの 時間を要し、特に所望の温度が高い(例えば200で以上) ほどプロセスタイムの増加し、この処理時間の増加 は、プロセスコストとして無視できなくなるという問題 があった。

10005]後者の熱圧着方法では、上記ヒーターが所 望の態度まで到離するのに時間を要する。また、ステー ジをあらかじめ所図の温度性しておく場合、アラインメ ント方法によっては不具合が生じていた。また、前途し たように、基板を加圧する前に高精度のアラインメント か必要であるから、CCDカメラを用いる場合は、 メラの軸ぶれや熱による像のゆらぎなどがアラインメントの妨げになるし、カメラの寿命が短くなるという問題 もあった。

[0007]

「課題を解決するための手限」請求項」に記載のインク ジェットプリンタへットの改進作機力がは、複数の基域 を接合機関してなる基板開爆作はよりインクジェットプ リンターッドの設盤を作取するに限し、接合するべき基 板間に、加熱により接着力を発現する接着利の層を介在 させ、試接着利限をランプ先派で加熱して基板団とを接 合することにより基板視線体を得ることを特徴とする。 「00081 換水項」の披露作機分法において、接合す

るべき基板間に上記接着剤の層を介在させる方法として は、(1) 基板間に上記接着剤層のみを介在させるも の、(2) 両面に上記接着剤層のみを介在させるも (例えば、プラスチックフィルム基材の両面に熱可塑性 樹脂系の接着剤を積層してなるラミネートフィルム)を

基板間に介在させるものなどが挙げられる。 【0009】請求項とに記載の液室作製方法は、請求項 1において、複数の基板がシリコンからなる(すなわち シリコン基板)ことを特徴とする。

【0010】請求項3に記載の被室作製方法は、請求項 2において、ランプ光源として短波長アークランプを用 いることを特徴とする。

【0011】請求項4に記載の液室作製方法は、請求項 1,2または3において、接着剤として熱可塑性ポリイミド系接着剤を用いることを特徴とする。 【0012】請求項5に記載の被室作製方法は、請求項 4において、熱可塑性ポリイミド系接着剤として、ガラ な転移温度が120℃以上のものを用いることを特徴と

【0013】請求項6に記載の擦塞作製方施は、請求項 4または5において、基板同士の接合工程がランプ光額 を用いる短時間の仮接合工程と、その後のランプ光額を 用いる本接合工程とを含むものであり、該本接合工程で は仮接合工程よりも長時間または高温の加熱を行うこと を特徴とする。

【0014】請求項7に記載の液室作製方法は、請求項 1,2または3において、接着剤として熱硬化性ポリイミド系接着剤を用いることを特徴とする。

[0015] 請求項1~7に保る製造方法では、接合時間に行うことができる。また、基板材料の基礎吸収波 長に合ったランプ光源を用いることによって、基板を高い加熱効率で加熱し、より短時間で接合を発了させることが可能となる。また、基板として機械加工が可能なシリコン基板を用いた場合には、ランプ光源に短波長アクランプ (接長が1μ・配根)を用いることで、基板を効率度(加熱することができ、度時間での整合が可能になる。さらに、ボリイミド樹脂系の接着剤を用いることにより、インク耐性が高く、しかも高ヤング率の接合が可能になる。さらに、ボリイミド樹脂系の接着剤を用いることにより、インク耐性が高く、しかも高ヤング率の接合が可能となる。

【0016】とくに、請求項をに係る作製力法では、熱 可避性ポリイミド系接着利の有機溶剤溶液を整備した 後、該輸布販から有機溶剤を乾燥、蒸発により除去して 一次硬化させる(フィルム化する)ことでカック性をな くすことができる。また、このクック性静除後に上配フ イルよ功の整剤層によって基板関土の接後を行うこと ができるため、耐ダスト性および輸送性に優れた接合工 程が実現できる。また、装着剤が熱可塑性抽箇系を合 であるためプレディングが発生しないので、接着剤の 「はみ出し」が抑制される。上記「プリーディング」と は、被点が最なる主刺と削利(添加剤のごちらかが先 にメルトし、洗験血粉をことである。

[0017] 一方、上記録報代性ボリイミド系接着剤の 使用方法としては、(1) 熱可塑性ボリイミド系接着剤の 動場と同じように、無疑性性ボリイミドを主体とする 接着剤を有機溶析に溶解して使用するものや、(2) ポリイミドの部域であるポリアミド腕の有機溶析をあるポリアミド腕の有機溶析と 基板表面に塗布した後、このポリアミド酸をペーキング (ランブ加熱) によりポリイミド化させるものなどが採 用できる。

[0018]

【実施例】本発明に係る液室作製方法の実施例を、図面 を参照して工程順に説明する。

実施例1 (請求項1, 2, 4に対応する)

工程1:インクジェットプリンタヘッドの被室(の一

部)を構成するための基板1 および基板3 を用意し、図 1 に赤すように基板1 (または基板3) の接合面に、業 可塑性ボリイミド病の接着剤2 を塗加した。この整合面と、 2 としては、主体である熱可塑性ポリイミドを適当な存 機溶剤に溶解した液状のものを採用した。未実施例で は、日東電工(株) 製の可塑剤としてシリコンが添加さ た変性ポリイミド銀脂をNMP(ローメチルピロリドン) に溶解した接着剤を採用した。また上記基板1,3 はシリコンからなり、あかじめ所定の機能加工が施され ているものである。

【0019】工程2: 基板1上の接着剤2のレベリングを50℃・10分の条件で行った後、予備乾燥を170℃で20分間行い、さらに250℃・10分の条件で接着剤中の溶剤の均一蒸発と接着剤層のフィルム化とを行った。

【0020】 工程3:図2に示すように、ハロゲンランブ4 a とその背面側に設けた反射板 4 b とからなるランプ集額の上がた。支持板6 b と発見らせからなる支持部材7を配置し、支持具6 b に、フィルム状の接着削層を形成した基板1 を軟さた。ついで、基板1 b に基板3 をアラインメント (位置合わせ) して転を 接触させた。止阪支持板6 b は、近美4 μ ш 以下の可提先の形とが透過する石灰で構成した。ついで、基板3 b に加圧板8 を重ね、2 k g f / c m² の圧力で基板1,3 を加圧した。

[0021] 工程4:上配加圧状態を維持しながらハロ ゲンランブ4aの出力を上げ、基板およびフィルム状後 着剤を加熱した。この場合、およそ20秒で250℃ま で昇値させ、250℃で30秒間保持した後、ランプ出 力を下げて基板同士の接合を完了させた。

【0022】工程5: 実持部が17から接合後の基板1, 多取り出して室温まで放冷し、工程1~4を繰り返す ことにより基板3上に別のシリコン基板を接合すること で、3枚の基板からなる基板独合体を得た。以下同様に して、インクジェットプリンタへットの液密構成とが な枚数の基板を接合して所型の基板積極体を得た。

【0023】実施例2 (請求項3に対応する)

シリコン基板として基礎吸収を長が1μm前後のものを 採用するとともに、ランプ光額として短波長アークラン ブ (波長1μm) を用いた。実施例1の工程1~3と同 様に処理した後、上記工程4と同様に、アークランブの 加力を上げて基板およびフィルム状接着剂層を加熱する ことで基板同土の接合を行った。この場合、10秒間で 250℃まで昇程させ、250℃で30秒間保持した で、ランプ出力を下げて接合を完了させた。この実施例 では、基板の吸収波長に合った波長のランプ光額を用い ることにより、基板を効率良く、しかもより均一に加熱 することができた。

【0024】実施例3

図3に示すように、実施例1で得た基板積層体10(1

0 a, 10 b) を振動板13に接着して液室11を作製した。この場合、接着利12としてガラス転移租度(TG)が80℃の熱可塑性ポリイミド系接着剤を用い、実施側1と同様の丁料に従った。

【0025】実施例4 (請求項5に対応する)

実施例3と同様の方法で図4に示す被室11を作製した。ただしこの場合、接着剤12としてTGが130℃の熱可塑性ポリイミド系接着剤を用いた。

【0026】 [実施例3, 4で作製した液室の評価] 図 3に示すように、実施例3で作製した液室11に圧電素 子20を、エポキシ系接着剤21を用いて接着した。こ の接着は、振動板13と圧電素子20とを圧力3kgf / c m2 で加圧しながら、接着剤21を110℃に加熱 することにより行った。別に、実施例4で得た被室に図 3と同じ圧電素子20を、上記と同一条件で接着した。 【0027】その結果、実施例3の被室11と圧電素子 20との接着体では、基板積層体10aの(図3におい て右側への) 位置ずれが発生し、基板積層体10bで は、上記位置ずれと逆向きの接着刺12の「はみ出し」 12 a が観られた。これらは、圧電素子20の接着時に 接着剤12が軟化した (TGが80℃と低いため)こと に起因していると考えられる。これに対し実施例4で作 製した被室11と圧電素子20との接着体では、図4に 示すように、上記不具合は観られなかった。

【0028】実施例5 (請求項6に対応する)

図1に示す実施例1では、ランブ加熱時に基板1のうち 支持具6で支持された部分(支持具6と接触する部分) や、基板外隔の固度が低くなるため、これもの部分の 接着が不完全になる場合がある。これを防止するための 対策としては、仮接合と、その後の本接合とを組み合わ せた接合方法が有効である。以下、この方法の実施例に ついて説明する。

【0029】基板同士のアラインメントを行った後、仮 接合工程では、基板を低圧 (0,5kgf/cm2)で 加圧しながら200℃・5秒間保持した。こうすること で、接着面において接着不完全な箇所が残るものの、ハ ンドリングに十分耐えるだけの接着力が得られた。この 低圧・短時間の接着プロセスである仮接合を繰り返すこ とにより、インクジェットプリンタヘッドの被室構成に 必要な枚数の基板を仮接着して仮積層体とした。そして 最後に一回、本接合工程として、この仮積層体を圧力3 k g f / c m2 で加圧しながら250℃・3分間加熱す ることで、仮接合時の接着不完全な箇所の接着を補償す ることができ、これにより短時間で、信頼性の高い接合 を実現することができた。この本接合には、ヒーター内 臓の加圧基板を持つ圧着装置を使用したが、別の方法と して、仮積層体を加圧治具で加圧し、この加圧治具を加 熱炉に挿入することで基板同士の加熱圧着を行う方法も 採用できる。

[0030]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明に よれば以下の効果が得られる。

(1) 請求項1~7の発明の効果

インクジェットプリンタヘッドの被盗を構成するための 基板両上を接着するに際し、基板両に接着列電を介在さ せ、基板をランブ加熱で集中的に加熱することにより、 上記建着剤量を加熱して接着力を発現させるようにした ので、基板両土の核合を照時間に効率段く行うことがで きる。また、基板材料の基礎吸収液反に合ったランプ光 販を用いることにより、より高い熱効率で基板を加熱 し、より短時間で接合を充了させることが可能となる。

【0031】(2)請求項2の発明の効果 基板としてシリコン基板を用いるので、高密度ヘッドに

対応した微細加工が可能になる。

【0032】(3)請求項3の発明の効果

上記基板として基礎吸収波長が1μm前後であるシリコン基板を、ランプ光源として短波長 (1μm) であるア ークランプをそれぞれ用いることで、基板を、したがって接着利層を効率良く加熱することができ、短時間での 接合が可能にかる。

【0033】(4)請求項4の発明の効果

接着剤として頼可塑性ボリイミド系接着剤を用いること で、耐インク性が良好なうえ高ヤング率の接合を容易に 実現することができる。また、上配接着剤を有機溶剤に 溶解した被状態着剤を基板要而に飽布後、上即有機溶剤 を蒸発除去して一次硬化(ワイルル化)させることによ リタック性をなくした後に基板間土を接合することが可 がであるから、耐ゲスト性・横逆性に優九た接合工程が 実現できる。また、接着剤が熱可塑性のものであるた め、ブリーディング(メルトして流動すること)や、接 彩剤のはみ出し。を抑制されている場合であるた が利のはみ出し。を抑制されている場合であるた が利のはみ出し。を抑制されている場合であるた。 が利のはみ出し。を抑制されている場合である。

【0034】(5)請求項5の発明の効果

上記ポリイミド接着剤として、ガラス転移追度が120 で以上のものを用いることで、その後の工程(圧電素子 の接着)時にポリイミド接着剤が軟化することがなくな るため、後工程後の接合不良が抑削される。

【0035】(6)請求項6の発明の効果

仮接合をランプ光源を用いて行うので、短時間での仮接 合か可能である。また、基板の接合枚数に応じて必要回 数だけ仮接合を繰り返し、最後に一回、本接合を行うこ とにより、仮接合時の接着不完全な箇所が的確に接着さ れるので、信頼性の高い接合を短時間で行うことができ る。

【図面の簡単な説明】

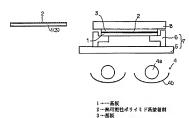
【図1】実施例1に係るもので、互いに接合するべき2 枚の基板のうち一方の基板表面に接着剤を塗布した状態 を示す断面図である。

【図2】実施例1に係るもので、2枚の基板を加圧・加 熱して接合する工程を示す断面図である。

【図3】実施例3において基板積層体により構成した液

室を示す断面図であって、接着剤としてTGが80℃の 支持板 5 熱可塑性ポリイミド系接着剤を用いた場合を示すもので 支持具 7 支持部材 ある。 【図4】実施例4において基板積層体により構成した液 8 加圧板 室を示す断面図であって、接着剤としてTGが130℃ 基板稽層体 10 の熱可塑性ポリイミド系接着剤を用いた場合を示すもの 10 a 基板積層体 10 b 基板稽層体 である。 【符号の説明】 11 液室 12 接着剤 1, 3 基板 12 a 接着剤のはみ出し 2 熱可塑性ポリイミド系接着剤 振動板 4 ランプ光源 13 ハロゲンランプ 20 圧電素子 4 a エポキシ系接着剤 21 4 b 反射板

[図1] [図2]



4 …ランプ光原 4 a …ハロゲンランプ 4 b …反射板

5 …支持板 6 …支持具 7 …支持部材 8 …加圧板

[図3] [図4]

